

无接触硅片厚度TTV电阻率综合测试系统(PV-1000)

产品名称	无接触硅片厚度TTV电阻率综合测试系统(PV-1000)
公司名称	北京合能阳光新能源技术有限公司
价格	.00/套
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:进口 型号:PV1000
公司地址	北京市通州区工业开发区光华路16号综合楼A207
联系电话	010-60546837 13718294863

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	进口
型号	PV1000	外形尺寸	50*38*54 (mm)
重量	123 (Kg)	产品用途	硅片测试
规格	TAO		

产品介绍

pv-1000系列无接触硅片厚度ttv电阻率综合测试系统为太阳能/光伏硅片及其他材料提供快速、多通道的厚度、(总厚度变化)ttv、翘曲及无接触电阻率测量功能。并提供基于tcp/ip的数据传输接口及基于windows的控制软件，用以进行在线及离线数据管理功能。

无接触硅片综合测试系统-产品特点

使用mti instruments独有的推/拉电容探针技术 每套系统提供最多三个测量通道 可进行最大、最小、平均厚度测量和ttv测量 可进行翘曲度测量(需要3探头) 用激光传感器进行线锯方向和深度监视(可选) 集成数据采集和电气控制系统 为工厂测量提供快速以太网通讯接口,速率为每秒5片 可增加的直线厚度扫描数量 与现有的硅片处理设备有数字i/o接口 基于windows的控制软件提供离线和在线的数据监控 提供标准及客户定制的探头 提供基于windows的动态链接库用于与控制电脑集成 用涡电流法测量硅片电阻率

无接触硅片综合测试系统-技术指标

晶圆硅片测试尺寸: 50mm- 300mm.

厚度测试范围：1.7mm，可扩展到2.5mm.

厚度测试精度： $\pm 0.25\mu\text{m}$

厚度重复性精度：0.050um

测量点直径：8mm

ttv测试精度： $\pm 0.05\mu\text{m}$ ttv重复性精度:0.050um

弯曲度测试范围： $\pm 500\mu\text{m}$ [$\pm 850\mu\text{m}$]

弯曲度测试精度： $\pm 2.0\mu\text{m}$

弯曲度重复性精度：0.750um

电阻率测量范围：5-2000ohm/sq (0.1-40ohm-cm) 电阻率测量精度：2%

电阻率测量重复精度：1%

晶圆硅片类型：单晶或多晶硅

材料：si, gaas, inp, ge等几乎所有半导体材料

可用在：切片后、磨片前、后，蚀刻，抛光以及出厂、入厂质量检测等

平面/缺口：所有的半导体标准平面或缺口

硅片安装：裸片，蓝宝石/石英基底，黏胶带

连续5点测量

应用范围

>切片

>>线锯设置

>>>厚度

>>>总厚度变化ttv

>>监测

>>>导线槽

>>>刀片更换

>磨片/刻蚀和抛光

>>过程监控

>>厚度

>>总厚度变化ttv

>>材料去除率

>>弯曲度

>>翘曲度

>>平整度

>研磨

>>材料去除率

>最终检测

>>抽检或全检

>>终检厚度

典型客户美国，欧洲，亚洲及国内太阳能及半导体客户。

详情欢迎来电咨询：

北京合能阳光新能源技术有限公司

北京市通州区工业开发区光华路16号

电话：010-60546837 -104传真：01060546837-608

联系人：肖经理18610357221 qq：454972757

email：xiaozongyong@henergysolar.com

公司网站：<http://www.henergysolar.com>

